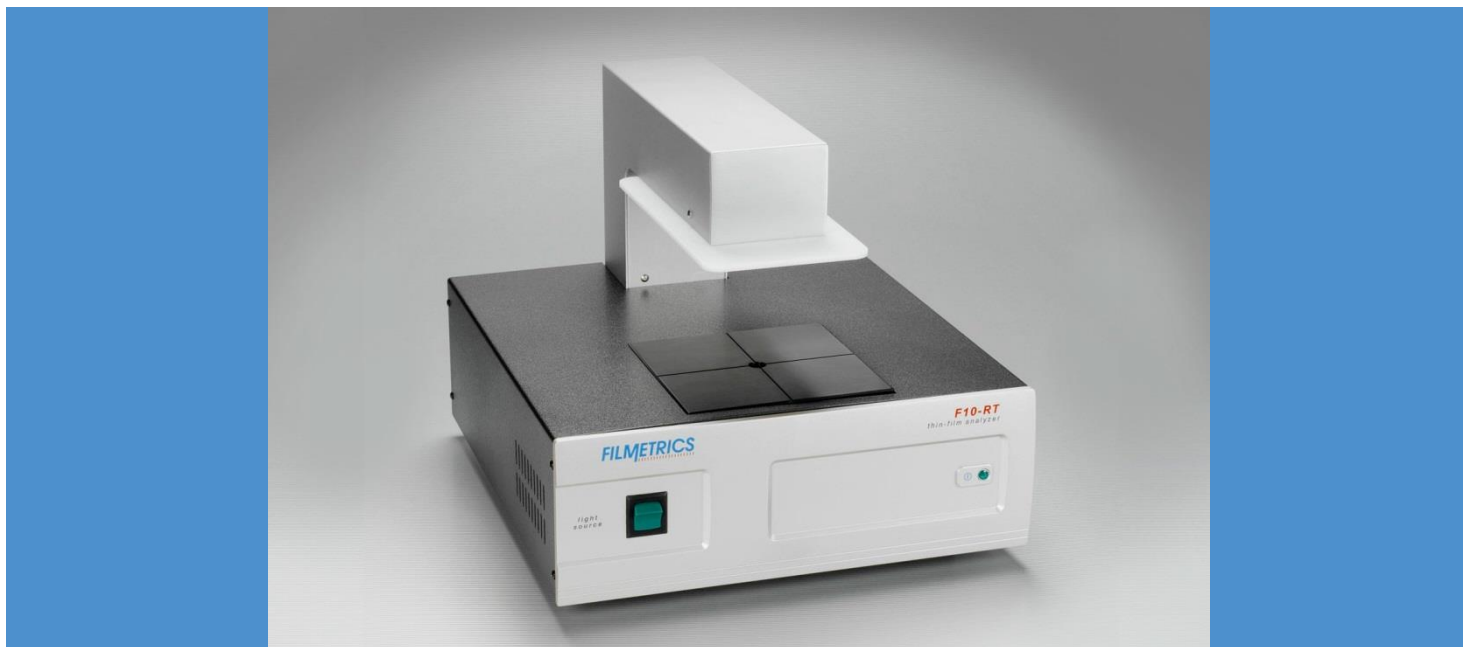


F10-RT

薄膜分析仪



同步测量薄膜的反射率/穿透率

不需要费时改变硬件配置，F10-RT-UV 仅需要透过单击鼠标就能够同时收集反射与透射光谱，不到一秒钟的时间，阵列的光谱仪就可以快速的收集到资料。另外，Filmetrics 专利的 Autobaseline 设计可以减少十倍以上的基础校准的参数读取时间。

分析优点

F10-RT 使 Filmetrics 的分析能力实现了同步测量反射率与穿透率。只要立即的点击鼠标就能够产生在客户是定波长范围内，得出最大与最小的反射率与穿透率。系统内置边缘检测分析与 FWHM 分析，以及能针线于常见的空间色彩系统的色彩分析（例如：CIELAB 与 CIEXYZ）。而测量光谱与其他的数据能够很容易的透过打印与导出或以 JPEG 图片形式来传送。同时，选配膜厚和参数解算模块使 F10-RT 具有与 Filmetrics F20 相同多层薄膜分析能力。

健全、可靠的集成

F10-RT 运送抵达时具有完整的标准配置，小巧的机身与 USB 接口保证使您容易安装。整机无任何运动件，初钨卤素灯外无需其他维护，确保设备高度可靠。

Filmetrics 优势

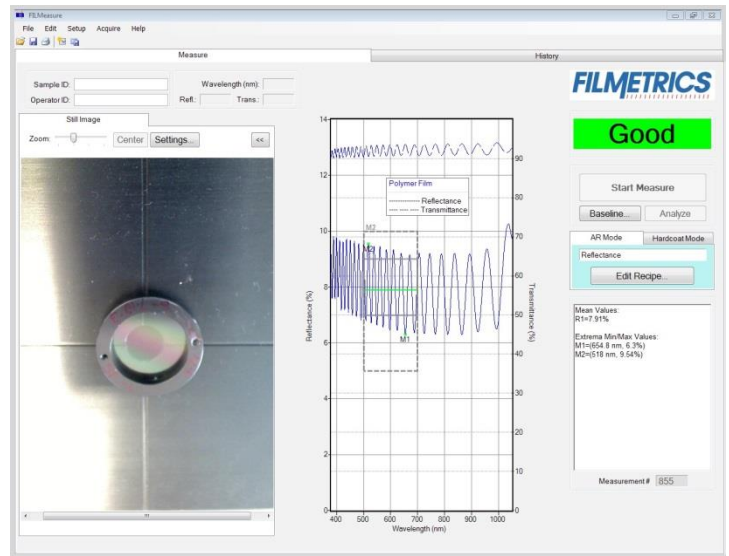
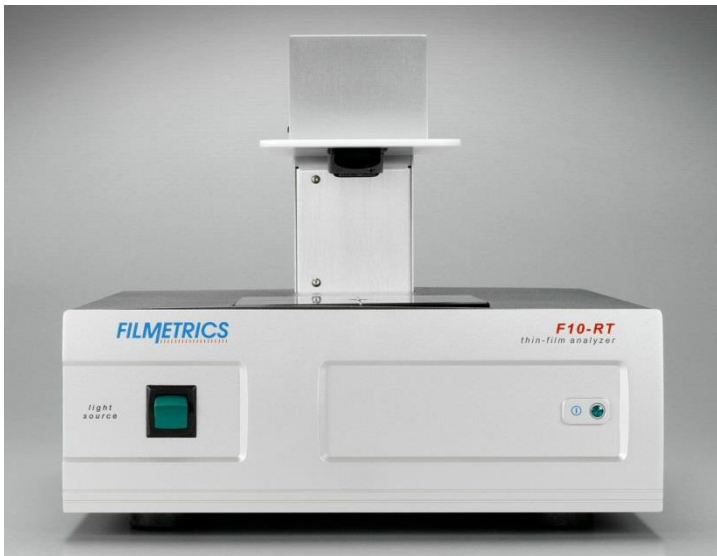
- 嵌入式在线诊断
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测量结果

免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

F10-RT

薄膜分析仪



F10-RT 让自动定量评测变得简单快速

厚度

测量范围*:	15 nm-70 微米
测量 n 和 k 值得厚度要求*:	100 纳米
准确度*:	0.4% or 2 纳米之间较大者
精度 ¹ :	0.1 纳米
稳定性 ² :	0.07 纳米

光谱仪

波长范围§:	380-1050 纳米
波长准确度:	< 0.5 纳米
波长重复性:	0.1 纳米
波长分辨率:	2.5 纳米
光度准确度:	0.005 埃
噪音:	< 0.0002 A 埃均方根
散射光:	500 纳米处 < 0.25%
振幅分辨率:	14-位元

§ 可依需求搭配选择 UV (紫外光)、NIR (红外光)、和 EXR (可见光加红外光)。

* 取决于材料。

¹ 测试厚度和光学常数时需要选配。

² 标准偏差为一天内在 Si 基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度的标准偏差。该值为连续 20 天测量的标准偏差值的平均值。

³ 2σ 是基于连续 20 天, 每天在基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值上得出。

基本要求

斑点尺寸:	6 毫米
光源:	钨卤素灯
高精度的暖机时间:	15 分钟
电源要求:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 20W

电脑要求

操作系统:	Windows XP (SP2) - Windows 8 (64-bit)
处理器速度:	至少 1.4 GHz
系统内存:	至少 512 MB
硬盘空间:	至少 50 MB
接口:	USB 2.0
屏幕分辨率:	至少 1024 x 768
互联网:	建议联网以便网上支持



优尼康科技有限公司

- Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc

